

350kPa 绝压压力传感器

概述

本产品是硅-硅键合结构的 MEMS 压阻式压力传感器芯片，采用 N 型衬底、P 型压阻形成惠斯顿全桥。在标准工作电源下，传感器可以输出与被测压力成良好线性关系的毫伏级电压信号，可适用于多种应用领域及不同的封装形式。

其特点如下：

- 芯片尺寸：1070 μm ×1070 μm ，厚度 250~600 μm 范围内可定制（默认 300 μm ）
- PAD 尺寸：100 μm ×100 μm
- 切割道宽度：100 μm
- 压力量程：350kPa；100~1000kPa 范围内可定制
- 非线性 $\pm 0.3\%$ FS
- 工作温度-40 $^{\circ}\text{C}$ ~125 $^{\circ}\text{C}$
- 应用范围：
 - 高度计/气压计
 - TMAP
 - TPMS/手持胎压计
 - 机油压力检测
- 绝压控制系统

引脚连线图

